

Japanese Unexamined Utility Model Publication No. 57-204528

Claim

An objective lens support used in an optical device in which an objective lens is elastically supported by a leaf spring, wherein said leaf spring is made of an amorphous metal.

The first leaf springs (2) and (3) are formed with an amorphous metal into a thickness of about 40 μ , and each comprises, as shown in Fig. 3, an outer ring (19) and an inner ring (20), and a plurality of spiral coupling sections (21) connecting the inner periphery of the outer ring (19) and the outer periphery of the inner ring (20). The second leaf springs (7) and (8) are also formed with an amorphous metal into a thickness of about 40 μ . Applicable amorphous metals include various ones such as Fe₈Co₇₂Si₁₀B₁₀ and Fe₆₀Cr₂₀P₁₃C₇.

The objective lens support of the invention has the configuration as described above. The amorphous metal used for the first leaf springs (2) and (3) and the second leaf springs (7) and (8) thereof has generally a high toughness and such a high yield strength as within a range of from 200 to 300 kg/mm², whereas the Young's modulus is about 1.0×10^4 kg/mm². Therefore, even when an abnormality is caused in the

optical or electric system of the objective lens apparatus, leading to considerable up-down movement of the objective lens holding cylinder (1), or to large horizontal sway of the objective lens (5), plastic deformation of the first leaf spring (2) or (3) or the second leaf spring (7) or (8) is never caused, or the optical axis of the objective lens (5) never inclines, or the focal position thereof never shifts.

When adopting a magnetic material such as $Fe_8Co_{72}Si_{10}B_{10}$ as the first leaf spring (2) in the aforementioned first and second embodiments to make use of the magnetic properties of an amorphous metal, the magnetic flux is shielded by the leaf spring (2), and it is thus possible to prevent magnetic effect on another magnetic circuit located near the objective lens apparatus.

From among the applicable amorphous metals, one having a relatively large chromium content such as $Fe_{60}Cr_{20}P_{13}C_7$ is excellent in corrosion resistance, and may be adopted for the first leaf springs (2) and (3) or the second leaf springs (7) and (8).

Further, while the first leaf springs (2) and (3) and the second leaf springs (7) and (8) have had a thickness of about 40 μ in the above-mentioned embodiment, a smaller thickness as about 30 μ may well be used in practice, and it

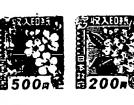
is also possible to further improve the sensitivity of the objective lens apparatus.

公開実用 昭和57一

204528











(4,700P3)

実用新案登録願(2)

昭和56年6月22日

特許庁長官殿

1. 考案交货券



2. 考 案 者 またりょうかと 東京多港区港南1丁目7番4号 ポジェックント・サンカイ ソニー株式会社技術研究所内 ノー サー カス 野 田 豊 和 (他1名)

3. 実用新案登録出願人

東京都品川区北品川6丁日7番35号 (218)ソ ニ ー 株 式 会 社 代表取録2 岩 間 和 夫

4. 代 理 人 〒160 東京都新宿区西新宿1の9の18 永和ピル 電話東京(の3)348-0222番(代表)

(6595) 弁理士 土 屋



(他1名)

5. 添附書類の目録 (1) 明

/(2) 図 ,(3) 顧 書 副 /(4) 委 任





354

56 091969 T 2045-28

'80.8-3,000

(1)

•

明 細 膏

1. 考案の名称

対物レンズ支持装置

2. 実用新案登録請求の範囲

対物レンスを核パネを介して弾性的に支持してなる光学デバイスにおいて、上配核が本を了モル、ファス全員によつて構成したことを特徴とする対物レンズ支持装置。

3. 考案の詳細な説明

本考案は光学式ディスクブレーヤに使用される対物レンズ装置の対物レンズ支持装置に関する。

光学式ディスクブレーヤに使用される対物レンス装置には、フォーカス方向(対物レンズの光軸方向)及びトラッキング方向(ディスク上のトラックの巾方向)の夫々の調整を行うため、対物レンズ保持衛を上下方向及び左右方向に移動可能にしたいわゆる2次元アクチェタが採用されている。この2次元アクチェタが採用されている。この2次元アクチェタリンズ保持管を上下方向及び左右方向に移動可能とすべく2枚以上の パネで支持したものが

(1)

355 2045 28

KM (HT)

ونست

一般的であつて、対物レンズ保持筒の駆動はこれ に取り付けられたコイルの電磁力によりなされる。 ところで、上配板パネの材料としては従来リン 青銅、ペリリウム青銅、ステンレス等が使用され てきた。これらの金属は、例えばリン育領板につ いてはその降伏強度が約90kg/mm²であつて。 対物レンズ装置を通常の状態で使用している限り はその機械的強度が特に問題となることはない。 しかし、対物レンス装置の光学系や電気回路に異 変を生じて、上記対物レンズ保持筒が大幅に動き、 その許容振響範囲を越えた場合。板パネに降伏応 力以上の力が加わつて塑性変形を生ずる。また、 対物レンズ装置をそのメインテナンス等のために 取扱う際、対物レンメ部に誤つて触れるなどした 場合にも同様のことが生ずる。そして根ベネが塑 性変形すると、対物レンズの光軸が傾き、集光性 能が劣化したり2次元アクチエタのサードが不安 定となる等の不具合を生じて対物レンズ装置の性 能が劣化する。また、2次元アクチエタの感度を 向上させるために板パネを薄くした場合には、上

述した不具合が生じ易いと共に、無負荷状態での 想べきのそりが大きくなる。従つて対物レンズ保 持備の軸垂性(レンズの光軸と入射光線の光軸と の平行性)を保つために対物レンズ装置の組立作 業において特別な考慮をはらう必要が生じ、組立 作業の能率を低下させるという欠点もあつた。

本考案は上述の如き欠陥を是正すべく削案する に至つたものであつて、上配板パネをアモルファ る異によつて構成することにより対物レンズ装 置の組立を容易にすると共に対物レンズ装置に対 が生じて板パネに過大な力が作用した場合でも、 対物レンズの光軸が傾いたり焦点位置がずれたり することのない対物レンズ装置を提供せんとする ものである。

以下本考案の実施例を図面に基づいて説明する。 第1図は本考案の第1実施例を示したものであって、対物レンズ保持簡(1)はその上下両端部をフォーカス調整用の第1の様パネ(2)及び(3)を介在して支持筒(4)に支持されている。また、対物レンズ(5)を支持する対衡レンズホルダ(6)はトラッキング

調整用の第2の板パネ(7)及び(8)を介在して対物レンズ保持筒(1)に支持されている。従つて、対物レンズ(5)は第1図で上下方向(フォーカス 立向)に交位で上方向(フォークグでは、フォークが巻き付けられている。対物レンズ保持筒(1)にはフォークでの第1のコイル(9)が巻き付けられている。の第1のコイル(9)はリング状の一対のヨーク(10)に対象形を一クを構成している。なお第1図で14はヨーク(10)と(1)の間に設けられたリング状のマグネットである。

第2の板バネ(7)(8)にはトラッキング調整用の第2のコイル(2)(3)が取り付けられていて、この第2のコイル(2)(3)には支持賃(4)に設けられたマグネット(3)(6)が対向して配置され、トラッキング調整用モータを構成している。

 の根パネ(7)(8)もアモルファス金属によつて枚厚40 #程度に形成されている。なお、アモルファス金 異としては種々のものを採用することが可能であ り、例えば Fe, Cov. Sin Bio 中 Fe, Cr. Piz Cyを用 いることができる。

対物レンズ支持装置は上述の如く構成されており、その第1の様パネ(2)(3)及び第2の様パネ(7)(8)に使用されているアモルフアス金属は周知の如く一般的に高い強靱性を有し、その降伏強度は200~300kg/mm²にも至る反面ヤング率は1.0×104kg/mm² 前後である。従つて、対物レンズ装置の光学系や電気回路に異変を生じて対物レンズ保持筒(1)が上下に大幅に動いたり、あるいは対物レンズ(5)が左右方向に大きく振れたりするようなことがあつても、第1の様パネ(2)(3)あるいは第2の様パネ(7)(8)が選性変形を生ずることがなく、対物レンズ(5)の光軸が傾いたりその無点位置がずれたりしてしまうことがない。

here

次に第2図は本考案の第2実施例を示したものであつて、トラッキング方向の駆動装置が上記録

公開実用 昭和57-

204528

1 実施例とヤヤ異なるものである。即ち、この場 合はトラッキング風動用の第2のコイル(2)何及び 対物レンス(5)が対物レンス保持簡(1)に直接取り付 けられ、対物レンズ保持筒(1)自体がその上端部を 中心としてヤヤ領を、トラツキング調整をなすよ うにされている。従つて第1<u>の板パネ(2)(3)</u>がフォ ーカス調整用とトラッキング調整用の両機能を兼 わることとなり、第1実施例における第2の様パ ネ(7)(8)は不要となる。この第1の板パネ(2)(3)は第] 実施例の場合と同様アモルファス全員により帯 成され、男3図に示すような形状とされている。 従つて板パネ(2)(3)は上下方向のみでなく左右方向 (半径方向)にもたわむが、上述したアモルファ ス金属の強靱性により対物レンズ保持簡(1)が大き く移動するようなことがあつても塑性変形を起こ すことがない。

From

また、アモルファス金属の磁気的特性に着目し例えば Fe a Co v. Si ve Bre のような磁性体を上配第 1 及び第 2 実施例における第 1 の板パネ(2)に採用した場合は、板パネ(2)により磁気フラックスがシー

ルドされ、対衡レンズ装置の近傍に位置する他の 磁気回路への磁気的影響を防止できる。

また、アモルファス金属のうち何えば Fe。 Cra。 Pia Co のようにクロームを比較的多く含んだものは耐熱性に優れており、これを第 1 の板パネ(2)(3)あるいは第 2 の板パネ(7)(8)に採用してもよい。

更にまた、上配実施例においては第1の板パネ(2)(3)及び第2の板パネ(7)(8)の板厚を40 A程度としたが、30 A程度に薄くしたものを用いても実用上差支えなく、対物レンズ装置の感度を更に向上させることも可能である。

また、上配実施例では第1の板パネ(2)(3)及び第2の板パネ(7)(8)の全てにアモルフアス金属を用いたが、一部の板パネにのみアモルフアス金属を用い他はリン青銅やステンレス等で構成するようにしてもよい。

本考案は上述の如く、光学デバイスの対例レンスを支持する様パネを製性が高く。かつまた降伏強度が大きいアモルファス金属によつて構成したものであるから、光学デバイスの光学系や電気系

here

公開実用 昭和57-204528

4. 図面の簡単な説明

図面は本考案を光学式ディスクブレーヤの対物 レンス支持装置に適用した実施例を示したもので あつて、第1図は第1実施例を示す継断面図、第 2図は第2実施例を示す継断面図、第3図は板バ ネの平面図である。

また図面に用いられた符号において、

(1) …… 対物レンズ保持简

(2)(3) …… 第1の板パネ

(4) · · · · · · 支持簡

(5) …… 対物レンズ

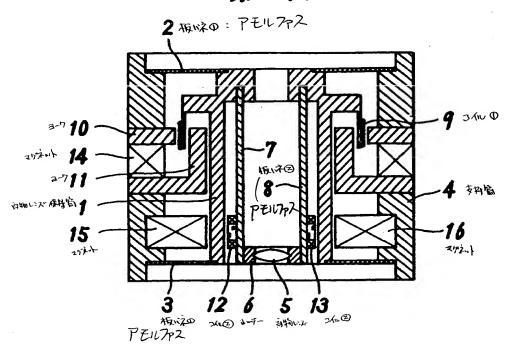
である。

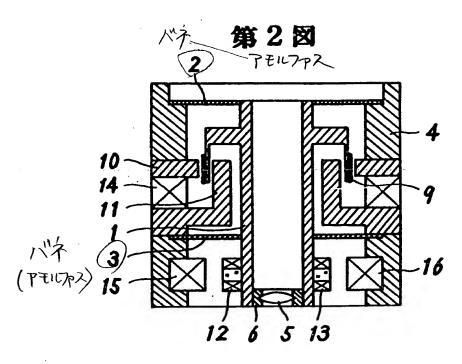
代理人土量勝

松村

公開実用 昭和57- 204528

第1図



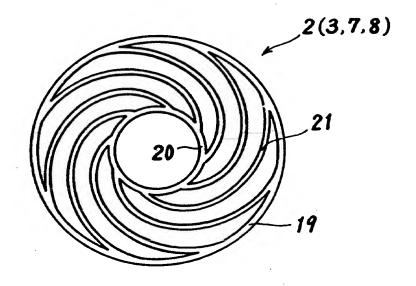


364

1 1/2

出順人代理人 土 屋 勝(他1名)

第3図



365

1.28 3/2

出順人代理人 土 屋 勝(他1名)



- 6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人及び代理人
 - (1) 考 案 者

東京都海区海南1丁目7番4号 東京都海区海南1丁目7番4号 サウェッテンタニテクリロテイ ソニー株式会社技術研究所内 *** 大 木 裕

(2) 実用新案登録出願人

(3) 代 理 人

〒 160 東京都新宿区西新宿1の9の18 永和ビル 電話東京(03)348-0222番(代表)

(7814) 弁理士 松 村



366

(自発) 手続補正書

昭和56 年9 月10日

特許庁長官殿

- 1. 事件の表示 昭和 **5 6** 年 実用新案登録頭 第 **9 1** 9 **6** 9 ^号
- 3. 補正をする者 事件との影響 実用新案登録出願人

東京都品川区北品川6丁目7番35号 (218)ソニー株式会社

4. 代 理 人 〒160 東京都新宿区西新宿1の9の18 永和ビル 電路東京(03)348-0222番(代表)

(6595) 弁理士 土 🗵



- 5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日
- 6. 補正の対象 考集の詳細な説明の機
- 7. 補正の内容





367





(1)、明細書館 6 頁第 6 行目の「従つて第 1 の板パネ(2)(3)」を「そして板パネ(2)とこの板パネ(2)よりも弾性に富むゴム、ウレタン等の非金属弾性体(3)」と補正する。

(2)、同第6頁第9行目及び12行目の「板パネ(2) (3)」を「板パネ(2)」と失々補正する。

- 以 上 -